
5 Low energy e-beam proximity lithography (LEEPL)*Utsumi, T.;*

Microprocesses and Nanotechnology Conference, 1999. Digest of Papers.

Microprocesses and Nanotechnology '99. 1999 International , 6-8 July 1999

Pages:32 - 33

[\[Abstract\]](#)[\[PDF Full-Text \(92 KB\)\]](#)**IEEE CNF**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [O](#)
[Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved